

## 1 化学実験のための基本操作

1.1 微量成分の分離と精製 .....	1
1.1.1 抽出 .....	6
1.1.2 溶解・沈殿・沪過・透析 .....	23
1.1.3 乾燥と保存 .....	38
1.1.4 帯融解法 .....	42
1.1.5 蒸留と昇華 .....	52
1.1.6 有機溶媒の精製 .....	69
1.1.7 純水のつくり方 .....	84
1.1.8 電気泳動法 .....	90
1.2 温度制御 .....	96
1.2.1 化学実験における温度制御 .....	96
1.2.2 電子式温度調節器の制御動作 .....	97
1.2.3 温度調節器の出力形態 .....	101
1.2.4 温度調節器の温度センサー .....	102
1.2.5 市販温度調節器の選定 .....	110
1.2.6 化学実験室における温度制御のための加熱 .....	112
1.2.7 化学実験室における温度制御のための冷却 .....	119
1.2.8 化学実験室における温度制御のための断熱材 .....	120
1.2.9 温度調節機能をもつ市販理化学機器 .....	121
1.2.10 汎用電気製品の実験室における応用 .....	123
1.3 気圧制御 .....	124
1.3.1 高圧装置 .....	124
1.3.2 減圧装置・真空装置・超高真空装置 .....	133

## 2 超臨界流体

2.1	超臨界流体の概要	165
2.1.1	まえがき	165
2.1.2	臨界点と超臨界流体	165
2.1.3	混合物の臨界点	167
2.1.4	臨界点近傍の溶媒物性	167
2.1.5	超臨界流体の溶解力	170
2.1.6	臨界点近傍での反応	172
2.2	超臨界流体の平衡・輸送物性と測定法	174
2.2.1	平衡物性	174
2.2.2	輸送物性	188
2.3	超臨界流体中のミクロ物性と測定法	200
2.3.1	超臨界流体のミクロ構造	200
2.3.2	回折法によるミクロ構造の測定	212
2.3.3	分光測定による超臨界流体中のミクロ構造	224
2.4	超臨界流体中の反応と測定法	235
2.4.1	超臨界流体の反応場としての特性	235
2.4.2	超臨界流体中の反応機構と速度	238
2.4.3	超臨界流体中の反応実験法	245

## 3 結晶成長と薄膜作成

3.1	無機材料の結晶成長	259
3.1.1	チョクラルスキー法	259
3.1.2	ブリッジマン法	264
3.1.3	磁場印加結晶成長法	268
3.1.4	まとめ	269
3.2	有機化合物の結晶成長	270
3.2.1	濃縮法	270
3.2.2	除冷法	271
3.2.3	封管法	272
3.2.4	円筒セル法	273
3.2.5	気流法	275
3.2.6	拡散法	275

3.2.7 電解法	276
<b>3.3 生体高分子化合物の結晶成長</b>	<b>278</b>
3.3.1 生体高分子結晶の特徴	278
3.3.2 結晶核生成と結晶成長	279
3.3.3 沈殿剤の種類と濃度の設定およびデータベースの利用	279
3.3.4 結晶化の方法	280
3.3.5 結晶化スクリーニング	283
3.3.6 結晶の観察	284
3.3.7 結晶化条件の精密化	284
3.3.8 X線回折強度測定	288
<b>3.4 薄膜生成</b>	<b>292</b>
3.4.1 単一分子試料の調製	292
3.4.2 C V D	301
3.4.3 MBE法(分子線エピタキシー法)	306
3.4.4 薄膜特性制御法	308

## 4 光関連基礎測定技術

<b>4.1 光源</b>	<b>313</b>
4.1.1 光源の諸特性	313
4.1.2 白熱電球とハロゲンランプ	314
4.1.3 蛍光ランプ	315
4.1.4 水銀ランプ	316
4.1.5 メタルハライドランプ	319
4.1.6 ナトリウムランプ	320
4.1.7 キセノンランプ	321
4.1.8 その他の放電ランプ	323
4.1.9 固体ルミネッセンス光源	325
4.1.10 レーザー	328
4.1.11 シンクロトロン軌道放射光	335
<b>4.2 光学素子</b>	<b>341</b>
4.2.1 光学ガラス	341
4.2.2 光学フィルター	352
4.2.3 非線形光学材料	357
<b>4.3 検出器</b>	<b>365</b>
4.3.1 光量計	365

xii 目 次

4.3.2 光電子放出利用検出器.....	370
4.3.3 内部光電効果利用検出器.....	379
4.3.4 热的検出器.....	388
<b>4.4 基礎分光計測装置.....</b>	<b>393</b>
4.4.1 分光装置.....	393
4.4.2 信号処理装置.....	406
4.4.3 低温測定.....	421
<b>索引 .....</b>	<b>427</b>